

## 手持式PDMS芯片等离子键合笔

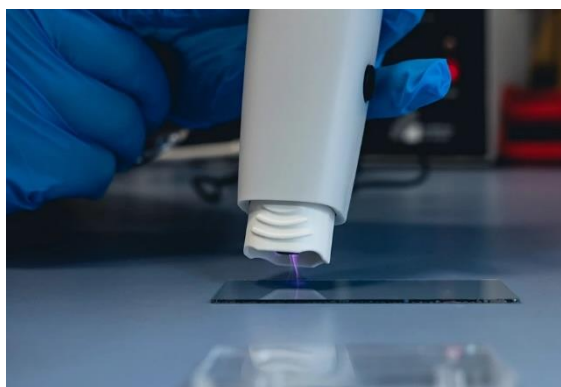
应用领域：细胞培养、食品科学、药物发现、化学合成

石油工业、纳米颗粒合成、功能材料制备等。

相关产品：微流体压力控制器BIP MPC、微流控压力泵 OB1 MK3+、  
流量传感器 MFS/BFS、同轴流玻璃芯片、注射泵Fusion4000-X

发布日期：2024 年 1 月

用于 聚合物PDMS 和玻璃键合的即插即用的等离子表面处理和键合仪器，专门用于实验室内的PDMS芯片键合。



### ● 轻便且用户友好

易于操作的设备，确保简单的微加工工艺

### ● 使用寿命长

可更换的头部确保您的设备具有更长的使用寿命

### ● 即插即用

简单设备的插头即可轻松启动等离子体生成

手持式PDMS芯片等离子键合笔是一款用于优化表面处理的二合一便捷工具，非常适合将 PDMS 键合到玻璃以及 PDMS 键合到 PDMS上。此外，它还提供传统等离子体室中常见的先进表面改性功能。

### 经过 PDMS 键合测试和批准

我们的专家团队已经测试了 Plasma Pen，以确保其彻底密封 PDMS 微流控芯片。结果显示，在高达 2 bar 的压力（PDMS 上使用的最大压力）下，粘合力完美，无泄漏。

简单的即插即用操作和轻便、易于操作的特点使其可以轻松地靠近表面进行处理。因此，手持式PDMS芯片等离子键合笔通过提供无与伦比的灵活性来促进和改善实验室工作流程，无论您在实验室的哪个位置，都可以轻松实现无缝 PDMS 芯片键合。

该设备符合 CE 标准，因此您可以完全安全地进行等离子处理。

### 可靠、持久的 PDMS芯片键合笔

该仪器经久耐用，等离子键合笔体内装有发

电机，可持续使用数十年。

此外，该头的使用寿命很长（足以粘合大约 1000 个芯片），并且如果需要，可以以低成本轻松更换。

用户友好的设备

等离子键合笔专为最佳用户体验而设计，将紧凑且符合人体工程学的设计与轻巧的结构和易于使用的 LCD 界面相结合。它旨在让您对各种操作参数（如计时器设置、功率水平和处理过程）进行卓越的控制。

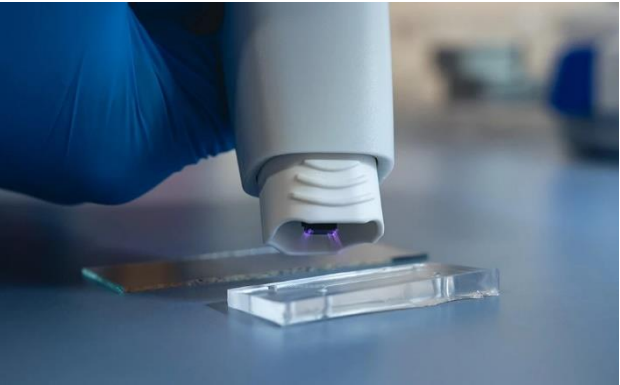


取代传统的大型等离子体清洗机，简化实验内的PDMS芯片键合步骤，节省时间空间和降低成本。

操作方法

- 1，将等离子笔的尖端放置在距要处理的表面约半厘米的位置。
- 2，将笔在要处理的表面上移动几秒钟（1 – 2 分钟足以处理显微镜载玻片）。
- 3，然后，只需对齐并按压处理过的表面即

可完成芯片组装。



生产 PDMS 芯片的完整工作站：

- 1，我们为您提供专业知识、设备和所需配件，帮助您构建稳健的制造流程。
- 2，2 小时内制作出您自己的芯片。
- 3，确保可重复的制造工艺，使每个芯片都符合同样严格的标准。

规格参数

重量	110 g
长度	215 mm
直径	27 到 38 mm
供电功率	110 V 到 230 V； 50/60Hz
功耗	18 W
等离子温度	<50℃
表面处理距离	2 到 10 mm
表面处理面积	5×5 到 20×20 mm <sup>2</sup> Large



天津市南开区万兴街长江道133号众望大厦C座502

提升效率 加速科学发现

邮箱：contact@techusci.com

笔记记录和备注: